

Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie

Fachausschuß Normung

Bericht zur Frühjahrssitzung 14./15.5.2001 Freiburg

DIN Normenausschuß Feinmechanik und Optik; AA O3 Dünne Schichten für die Optik

Verabschiedung neuer Normen:

- E DIN 9211-3 "Optik und optische Instrumente -Optische Schichten -Teil 3: Umweltbeständigkeit"
Verabschiedung Rosa-Druck
- E DIN 9211-4 "Optik und optische Instrumente -Optische Schichten -Teil 4: Spezifische Prüfmethoden"
ist weiter in Bearbeitung

Interessenten wenden sich bitte an Dr. U. Beck (BAM VIII.2901, Tel.: 030/8104-1821 oder -1829, FAX: -1827, Email: uwe.beck@bam.de)

DIN 50992 Schichtdickenmessung und Charakterisierung von Oberflächenwellen

Teil 1: Bestimmung von elastischen Konstanten, Dichte und Dicke von Schichten mittels laserinduzierter Ultraschall-Oberflächenwellen.

Deutsche Fassung: Einsprüche bearbeitet und als Norm verabschiedet
Englische Fassung liegt vor und bei CEN als Vorschlag eingereicht

Teil 2: Photothermische Schichtdickenmessung

Deutsche Fassung: Einsprüche bearbeitet und als Norm verabschiedet.
Englische Fassung liegt vor und bei CEN als Vorschlag eingereicht.

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik; Richtlinien-Fachausschuß

Im Rahmen der Erarbeitung einer Richtlinie zur Qualitätssicherung bei der Diamantbeschichtung von Werkzeugen wird zur Zeit an der Standardisierung der Klassifikation der verschiedenen Kohlenstoffschichten gearbeitet.

nächste Sitzung 23./24.10.01

VDI-W : VDI-Richtlinie # 3823 „Qualitätssicherung bei der Vakuumbeschichtung von Kunststoffen“

Blatt 1: Eigenschaften, Anwendungen und Verfahren
wird in den Gründruck verabschiedet.

Blatt 2: Anforderungen an zu beschichtende Kunststoffteile

Blatt 4: Prüfplanung für vakuumbeschichtete Kunststoffteile

Erste Entwürfe liegen vor.

Nächste Sitzung 11./12.6.2001

VDI-W : VDI-Richtlinie # 3824 „Qualitätssicherung bei PVD- und CVD-Hartstoffbeschichtungen“

Blatt 1: „Eigenschaftsprofile und Anwendungen von Hartstoffschichten“

Blatt 2: „Anforderungen an zu beschichtende Werkzeuge und Bauteile“

sind ins englische übersetzt und werden z.Z. gedruckt.

Blatt 3 "Fertigungsabläufe und -tätigkeiten"

Blatt 4 "Prüfung und Kontrolle von hartstoffbeschichteten Teilen"

sind in deutsch/englisch verfügbar.

VDI/VDE-GMA-Fachausschuß FG 3.40 „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“

Veranstaltungsankündigung:

VDI/VDE GMA Aussprachetag „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“,

6.-7.3.2002 Stuttgart

ISO/DIS 14577 Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters

Norm-Entwurf liegt vor.

Universalhärte soll Martens-Härte heißen. Ausdehnung auf den Nanobereich geplant.

ISO/TC 201 Oberflächenanalytik : Aktueller Stand

Organisation des ISO/TC 201:

- 8 Subkomitees und 1 Arbeitsgruppe
- 28 Länder sind durch ihre nationalen Standardisierungsorganisationen vertreten
- Hiervon sind 10 Länder "participating members" (China, Italien, Japan, Rep. Korea, Österreich, Russische Föderation, Schweiz, Slowenien, UK, USA).
- Weitere 18 Länder (u.a. Deutschland) haben Beobachterstatus.

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 201:

Insgesamt: 29, davon

ISO: 7 , DIS: 4 , CD: 5 , DTR: 1 , WD: 11 , NP: 1

ISO= International Standard; FDIS= Final Draft International Standard; DIS= Draft International Standard;

CD= Committee Draft ; WD= Working Draft ; AWI= Approved Work Item; NP= New Work Item Proposal

Internationale Normen, die aus der Arbeit des ISO/TC 201 hervorgegangen sind:

- ▶ **ISO14976** Surface Chemical Analysis -Data transfer format
(Norm bedeutsam für Austausch von oberflächenanalytischen Daten)
- ▶ **ISO14975** Surface Chemical Analysis -Information formats
(Norm bedeutsam für Austausch von oberflächenanalytischen Daten)
- ▶ **ISO 14237** Surface Chemical Analysis - Secondary ion mass spectrometry - Determination of boron content in silicon using uniformly doped materials
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)
- ▶ **ISO 14606** Surface Chemical Analysis - Sputter depth profiling - Optimization using layered systems as reference materials
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)
- ▶ **ISO 15472** Surface Chemical Analysis - X-ray photoelectron spectrometers - Calibration of energy scales
(Norm bedeutsam für akkreditierte Prüflaboratorien)
- ▶ **ISO 14707** Glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) - Introduction to use
(Norm bedeutsam für Automobil- und Stahlindustrie)
- ▶ **ISO 14706** Surface Chemical Analysis - Test method of surface elemental contamination on silicon wafers by total reflection X-ray fluorescence spectroscopy
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

ISO/TC 202 : AktuellerStand

Organisation des ISO/TC 202:

- 3 Subcommittees mit 1, 3 bzw. 1 Arbeitsgruppen sowie weitere 4 Arbeitsgruppen, die direkt dem TC Sekretariat unterstellt sind.
- 23 Länder sind durch ihre nationalen Standardisierungsorganisationen vertreten, davon sind 11 Länder "participating members" (Belgien, China, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Rep. Korea, Österreich, Russische Föderation, UK, USA). Eine aktive Rolle spielen Japan, China, USA und UK, alle anderen P-Mitglieder beschränken ihre Aktivitäten mehr oder weniger auf Ihr Stimmrecht.
- Auf Initiative des NIST wurde bei der Microscopy Society of America (MSA) eine Web-Seite zur Information über die ISO TC202-Aktivitäten eingerichtet (www.msa.microscopy.com/ISO/).

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 202:

FDIS: 0 , CD: 3 , WD: 2

Nr	Inhalt der Norm	Status
ISO 15632	Spezifikationen für energiedispersive Röntgenspektrometer	DIS
ISO 16700	Vorschrift zur Kalibrierung der Vergrößerung am REM	CD
ISO 14594	Testmethoden für Elektronenstrahl-Mikrosonden	CD
ISO 15595	Anforderungen an ein CRM für die Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD
ISO 17470	Vorschrift zur qualitativen Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD
ISO 22489	Anleitung zur quantitativen Punktanalyse bei der ESMA	NP
ISO 22302	Anleitung zur quantitativen Analyse mittels EDX	NP
ISO 17270	Vorschrift zur Durchführung der ELS am STEM	AWI

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

gez. G. Reiners

Tel.: 030/8104-1820; FAX: -1827, Email: georg.reiners@bam.de

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/fachgruppe_82.htm